A 6

半導体レーザー励起マイクロチップ固体レーザー

Microtip solid state laser pumped by a laser diode

佐々木孝友、小栗修、中井貞雄*

大阪大学工学部、レーザー核融合研究センター*

Faculty of Eng. and Institute of Laser Eng.", Osaka University

1. まえがき

半導体励起固体レーザーの特徴は小型という点にあり従来からレーザー材料にはNd:YAGの直径数 mm,長さ3~10mm寸法の物が使われ、これにマイクロレンズやファイバ系を用いて半導体レーザーで 励起するという構成がとられてきたが最近さらにマイクロ化が進み固体レーザー材料は1mm角かそれ 以下のレーザー媒質長が極めて短いものが出現してきた。ここではこのようなレーザーをマイクロ チップレーザーとは言うことにする^{1,2)}。

これらマイクロチップレーザーの特徴は、①超小型、②横、縦両モード共単一発振が容易、③長 寿命、④低費用、である。その原型はすでに10年以上も前に日本のNTTグループが報告している³¹。 当時は光通信用光源として開発されたものであるが、最近になって高出力の励起用半導体レーザー が開発されるようになったため、再び注目されるようになってきた。このようなマイクロチップ固 体レーザーでは励起光を十分に吸収できるような吸収係数の高いレーザ媒質が必要で、また吸収係 数が高いことを利用することにより共振器長を大きくとったままで容易に単一縦モードを得ること ができる。従って共振器内に非線形光学結晶を導入することができ、超小型のグリーン・ブルー光 発生装置を作ることができる。これらは超小型故に大量生産により低価格が実現でき、センサー、 光計測、高密度光メモリー、カラーディスプレー等多くの分野でその応用を考えることができる。 ここでは特に計測用として重要な単ーモード発振を中心に筆者等が今までに得たNd:YVO4マイクロチ ップレーザー特性について1.06μm光発振と二倍高調波発生につき報告する。

2. 吸収係数の大きなレーザー媒質を用いることによる単一縦モード発振

従来、単一縦モードを得るには共振器に工夫を加えることにより単一モード化が計られている。 1)リング型共振器を用いる方法、2)定在波共振器で① λ /4板や②エタロン板を用いる方法、③共振 器間隔を狭くする方法等が報告されている。これらに対し、④吸収長が極めて短いレーザー材料を 用いることにより単一縦モード化を計ることができる⁴⁾。共振器内に一様なゲインがある状態を考 える。第一のモードが発振しており、これにより逆転密度分布に空間的ホールバーニングが生じる ものとすると第二モードに対するゲインは、共振器ミラー端では零になり、ミラーから共振器の中 心に向かって除々に増加してゆく。このため吸収長の短い材料を用いて共振器端からごくわずかの レーザー媒質のみを励起してやれば第二モードのゲインを極めて低く押さえることができ単一モー ド発振が可能となる。この方法で単一モードを得るのに重要なのはレーザー媒質の吸収長であり、 共振器長ではない。したがって共振器長を多少長くしても差し支えなく、高調波発生用素子などを 共振器内部にいれても単一モード動作をさせることができる。

空間的ホールバーニングの生じにくい材料を選ぶのも単一縦モードを発振させる上で重要な要因 である。励起状態の空間的緩和に関してはYAG,NPP等に関して調べられている。励起状態の空間的な 拡散効果は、通常励起イオンと隣接の励起されてないイオン間との双極子相互作用によるといわれ ているが、励起イオンのエネルギーが隣の励起されたイオンをさらに高いエネルギー状態に励起す るオージェ効果によるものなどもLNPなどで報告されている⁵¹。いずれが主にきくにしても要は添加 するレーザーイオン濃度を大きくし、隣接イオン間距離を短くしてやればよい。ただしイオン濃度 を大きくすれば一般的に蛍光寿命が短くなり発光強度が落ちる濃度消光の問題が生じる。

3. Nd:YVO4マイクロチップレーザー実験

3.1 高効率1.06µm発振

実験装置の概略をFig. 1に示す。半導体レーザーは1W級(SONY:SLD304V、またはMITSUBISHI:M404 9E2)を用い、集光には3枚のレンズを用いた。集光径は弱励起時で100μm、150μm、強励起時で10 0μm、230μmの楕円形であった。レーザー材料にはa軸カットNd:YV04と比較のためNd:YAGを用いた。 これらのNd濃度、吸収係数及び吸収長をTable 1に示す。結晶は厚み1mmの平行平板で、片面には共 振器のミラーとして99.9%高反射コート、他面には無反射コートを施した。出力ミラーに反射率95%、 曲率50mmのものを用いた時の基本波の出力パワーをFig. 2に示す。共振器長は10mm、Nd濃度1.1at% の時励起760mWに対し出力325mW、変換効率54.6%が得られた。濃度を1.78%から2.02%と濃くすると出 力の低下が見られたが、これはFig. 3に示すようにNdが濃過ぎると濃度消光が見られるためであろ う⁶⁾。共振器内における発振径はNd濃度に関係なく約70μmで共振器構成で決定される計算上の径と ほぼ一致していた。

3.2 1.06μ m単一縦モード発振特性

同様の実験を出力側に平面ミラーを用いて行った結果をFig. 4に示す。実線は単一モードを、破 線はマルチモード出力を示す。単一モードは圧電素子を出力ミラーに付け共振器長を微調すること で得た。2.02at%Nd:YV04では、吸収パワー690mWに対し最高出力221mWまで単一縦モードが得られた。 この値はKintzら⁷⁾が励起状態に空間的拡散がないと考えた場合に計算上得られる値より約1.6倍大 きく、実際にはエネルギーの空間的拡散が結構あることを意味している。一方1.1at%Nd:YV04では最 高120mWの単一縦モード発振(吸収パワー530mW)しか得られなかった。またYAGでは吸収係数が低い ため、出力も小さく縦モードも単一にはならなかった。

平面ミラーの場合の発振径を測定した結果をFig. 5に、またこの時の発振径に対して得られた基本波出力をFig. 6に示す。ただしこの場合二倍高調波発生実験を行うために出力側ミラーには反射率99.8%のものを用いた。球面ミラーの場合と異なり発振径はレーザー媒質の吸収係数により決定されることがFig. 5より分かる。さらにFig. 6から分かるようにレーザー媒質の濃度が濃く発振径が小さい程、出力が大きくなっている。平面ミラーの場合はレーザー媒質の吸収が大きいほど空間的なパワーの集中が起こり、このため誘導放出が強くなり出力が増加するものと思われる。発振径が小さくなることと、基本波出力が増加する二つの要因を考慮すると2.02%Nd:YVO4は1%Nd:YAGに比べSHG Enhancement Factorで約170倍となる。

3.3 単一縦モードによるグリーン光発生

グリーン光発生には2.02at%のNd:YVO₄を用い、厚さ7.0mmのKTP結晶を共振器内に入れてタイプⅡ型により行った。吸収パワー620mWのとき、16mWのSHG出力が得られた。このときの基本波も単一縦 モードであった。吸収パワーとSHG出力の関係をFig.7に示す。

KTP結晶を内部共振器型でType 11型のSHGに用いるときにはKTP結晶が複屈折の働きをするため、 出力一定の安定したSHG光を得るためには温度の管理が必要となる。Fig. 8は結晶長4.3mmのKTPの温 度を変化させた時に得られる基本波Pω(total)、Pω(C)と二倍高調波P₂ωの出力特性を示す。 P ω(C)はNd:YVO4の c 軸方向の偏光成分を、Pω(total)は偏光に無関係な全出力を示す。 Pω(tota 1)はKTPの温度に無関係に一定であるが、Pω(C)は29℃の周期で変動しており、これはKTP結晶長の 温度変化から計算される常光線と異常光線の位相差により生じる偏光成分の変化と一致する。KTPを 入れない場合はNd:YVO4はC軸方向の偏光成分の利得が高いためこの成分のみが発振するがKTPのよう な複屈折板を挿入した時にはc軸に垂直な成分も発振できることを示している。SHGは基本波の発振 光の偏光成分がC軸に平行な時か、またはそれに垂直な時に最も強くなり、その中間の時に最も弱く なりその変動周期は基本波の二倍になる。

最大のSHGを得る方法にはKTPが丁度λ/4板の長さになればよい。 このためには①結晶の温度を変

える、 ②結晶の傾きを変える、 の二つがある。 ①の方法では最大29/4℃=7.2℃変動させれば必ず最 大出力が得られる。 KTPの温度許容幅は25.7℃・cmなので4.3mm長では60℃となるから、 7.2℃は十分 許容幅内である。 ②の方法では必要最大傾き角はΔφ=0.712°となるが、 角度許容幅は16.7mrad・c mなので、 これは4.3mm長に対して2.23°となり、 これも許容幅内に入る。 このように①または②の 方法でKTPをλ/4波長板としてから、 次に光軸まわりにKTPを回転させることで発振光の偏光方向を 最適化することでSHGを最大とすることができる。

4. あとがき

半導体レーザー励起Nd:YVO4マイクロチップレーザーの単一縦モード発振特性とグリーン光発生について述べた。これらは超小型、長寿命でしかも単一縦モードであるため、今後計測、光情報処理 やその他の分野での応用が極めて有望と思われる。

(参考文献)

1)小島哲夫他: レーザー研究 18 (1990)646., 2)佐々木孝友: オプトロニクス (1990) No12 p55, 3)K.Kubodera et al: Appl. Opt.18 (1979) 884., 4)A.E.Siegman: Lasers (University Science Books, 1986) p.465., 5)K.Otsuka et al: IEEE J.Quantum Elctron. QE-16 (1980) 538., 6)永元 浩一他: レーザー研究 18 (1990) 646., 7)G.J.Kintz et al: IEEE J.Quantum Elctron. QE-26 (1990) 1457.

Table 1 Nd consentration vs.absorption coefficient, absorption length in YVO4 and YAG lasers.

レーザー材料	Nd濃度 (at%)	吸収係数α (cm ⁻¹)	吸収長1/α (mm)
a軸カット Nd:YVO₄ (c軸偏光)	2.02	71.5	0.14
	1.78	54.4	0.18
	1.1	31.4	0.32
Nd:YAG	1.1	8.5	1.18





Fig.2 1.06µm output power vs. absorbed power. (Output mirror:R=95%,R=50mm)



Fig.3 Life time and fluorescent intensity vs. Nd³⁺ concentration in YVO₄

